

VIEW MicroLine 300

MicroLine™ 300是一款高性能测量晶圆,光罩,MEMS和其他微加工设备等关键尺寸的自动化测量系统。该系统配备了高质量光学显微镜和精密移动平台,可对200mm的晶圆上0.65微米到400微米的特征尺寸进行全自动的精密视场测量。

关键尺寸的自动化测量系统

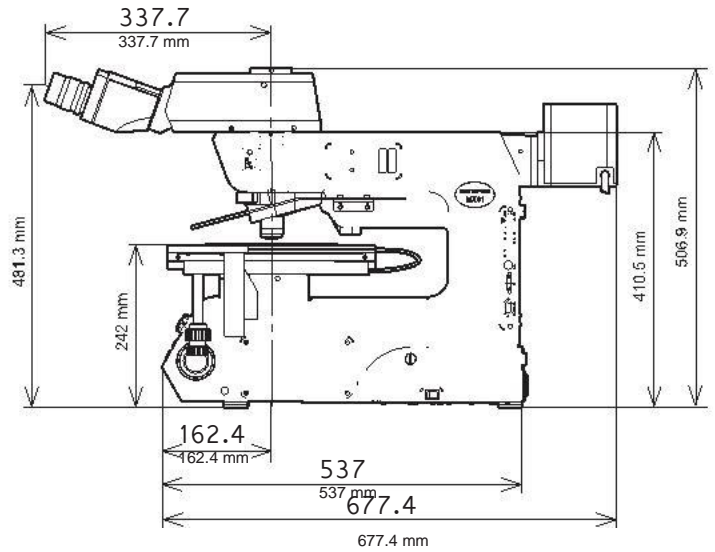
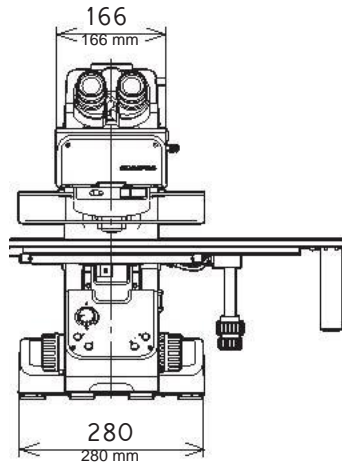
- 灵活的自动聚焦获得最佳影像质量
- 可编程的灯光强度
- 用于测量透明层,不规则边缘的线,以及更多的强劲性能

	X	Y	Z
行程(毫米)	200	200	25



计量软件:

- VIEW Metrology Software (VMS) – 手动平台
- 可选项: VMS 离线工作软件



Uncrated: 56 kg
Crated: 110 kg

	标准	可选
X,Y,Z 测量范围(毫米)	200 x 200	300 x 300
Z 自动聚焦范围 (毫米)	25	
XY 平台	交叉滚轴和手动同轴定位以及快拆杆	加入玻璃台面使用透射光
Z 平台	弹簧, 齿条和齿轮垂直运动与双粗/精调旋钮	
最大载重	2 kg	
成像光学	奥林巴斯光学显微镜, 包括水平明视场/暗场照明, 标准相机安装管, 电动的五目物镜转换	
前置透镜(视场可交换) 10X 明视场	50X 明视场	5X明视场 或 明/暗视场 10X 明视场或明/暗视场 20X长工作距离, 明视场或明/暗视场 100X长工作距离, 明视场或明/暗视场 150X 长工作距离, 明视场或明/暗视场
计量相机	1.4 兆像素 (1392 x 1040), 1/2-英寸, 数码, 单色	2.0 兆像素 (1628 x 1236), 数码, 单色
照明	全波段光谱, 可编程的钨卤素灯同轴面光	全波段光谱, 可编程的钨卤素灯 投射光 可调节的 N.A. stop
控制系统	四核处理器, Windows 7 操作系统, 网络和通讯端口	
控制器组件包		单一LCD平板显示器, 计算机鼠标键盘 双液晶平板显示器, 计算机鼠标键盘
电源要求	115/230 VAC, 50/60 Hz, 1-Phase, 500W	
相关环境	温度: 20°C ± 5°C 温度变化: <2°C 每小时 相对湿度: 30% - 80% 振动: per ISO VC-B	振动: per ISO VC-C (150X物镜)